

マスフローコントローラ： 比例流量制御バルブ VEMD

FESTO

Dynamic
and
flexible!



エア, 酸素, 不活性ガス用

Highlights

- 様々な流量範囲：
10, 20, 50, 100, 200 l/min
- アナログとデジタルのインタフェースを搭載
- 最高の価格クラス
- 最高の動的応答性
- リニアの制御応答性
- 丈夫で高い耐久性

多くのアプリケーションにおいて、エアやその他の気体の流れは制御されなければなりません。酸素はライフサイエンスの分野だけでなく食品やバイオテックにおいてもますます重要となるでしょう。生産時の保護ガスの制御に使用する場合や医療デバイスの呼吸用に使用する場合でも、ガスは常に正確に投与されなければなりません。そして信頼性や性能に関する高いデマンドに適合することがコスト効率と同じように重要なのです。新しいVEMDは高動的応答性と魅力的な価格の両方を実現します。

簡単な比例制御

マスフローコントローラの出力における気体の流れはリニアモードでのセットポイント指定により簡単に調整・制御することができます。0~10V, 4~20mA, Ethernet/ModBus TCP, ModBus RTUを持つRS232/RS485などの様々なアナログ/デジタルインタフェースが利用可能です。

ダイナミックで正確

統合されたサーマルセンサを使った制御ループによってVEMDはダイナミックかつ精密になり、セットポイントの変更に対して迅速に応答します。

フレキシブル

より多くの流量範囲：VEMDは0~10 l/minから0~200 l/minまでの流量範囲をカバーします。実際の流量値も、どのインタフェースを使用するかに関係なく上位のコントローラでも利用可能です。

静音性

比例制御バルブテクノロジーにより、流量の制御にパルス幅変調信号は必要ありません。つまり比例流量制御バルブ VEMDは非常に静かに動作するのです。

マスフローコントローラ： 比例流量制御バルブ VEMD

コンフィグレーション例

VEMDで選べるもの：

- 流量範囲 0～10, 0～20, 0～50, 0～100, 0～200 l/min
- ディスプレイ付/なし
- M5またはG1/4ねじとフランジ接続(オプション)



流量調整のアプリケーション

エア, 窒素, 酸素などの不活性ガスの流量調整

医療デバイス

- 空調, 手術器具, 消耗品の製造におけるエア, 窒素, 酸素, その他の不活性ガスの制御

バイオテクノロジー

- 細胞培養向けのエア, 酸素, CO₂の投与

産業製造

- 保護ガス投与
- 冷却や温度制御用の空気の計量

食品製造

- 食品製造における攪拌時などの窒素などの保護ガス投与

General technicalデータ

機能	値
マスフローコントローラ(MFC)	サーマルフローセンサ内蔵デジタルコントローラ
流体	エア, 窒素, 酸素, 不活性ガス(悪性ガスや爆発性ガスには適さない)
流量範囲	0～10, 0～20, 0～50, 0～100, 0～200 l/min(エアに対して校正)
サブライ電圧	12～24V DC
セットポイント値と電流フローのインタフェース	0～10V, 1～5 V, 4～20mA Modbus TCP搭載Ethernet Modbus RTU搭載RS232/RS485